

## ВЛИЯНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ НА ГАЛЬВАНОМАГНИТНЫЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$

Баранский П. И., Беляев А. Е., Городничий О. П., Комиренко С. М.

Представлены результаты исследований температурных и магнитополевых зависимостей гальваномагнитных и фотоэлектрических параметров пластически деформированных посредством индентирования кристаллов  $n\text{-Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$  ( $x \approx 0.2$ ). Показано, что пластическая деформация приводит к образованию подвижных при  $T \approx 300$  К дислокаций, проявляющих геттерирующее действие по отношению к имеющимся в образце неконтролируемым примесям. Установлено также, что наблюдаемый в деформированных кристаллах рекомбинационный уровень с  $E_i \sim E_g + 50$  мэВ имеет дислокационную природу.

Время жизни неравновесных носителей заряда (ННЗ)  $\tau$  в полупроводниках существенно зависит от их совершенства. Изучение этой зависимости — одна из актуальных задач в установлении кинетики таких полупроводников, как  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$  (КРТ), который является базовым материалом для создания приемников излучения в ИК диапазоне.

Проведенные на кристаллах  $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$  (с  $x = 0.195 - 0.300$ ) исследования [1-4] показали, что значения  $\tau$  для образцов одного и того же состава могут существенно различаться (от 0.5 до 10 мкс), а вид зависимостей  $\tau = f(T^{-1})$  (особенно в области  $T < 150$  К) во многом определяется технологией получения материалов и методикой их обработки. В связи с этим в [5-7] на кристаллах КРТ были проведены исследования влияния искусственно создаваемых дефектов и неоднородностей на фотоэлектрические и гальваномагнитные свойства. Эти исследования показали, что обработка кристаллов КРТ ультразвуком, а также электронное и  $\gamma$ -облучения приводят к заметным изменениям (в области примесной проводимости) значений подвижности  $\mu$ , концентрации равновесных носителей  $n$ , времени жизни ННЗ  $\tau$  и их температурных зависимостей.

В частности, одним из приемов введения дефектов является индентирование поверхности кристаллов, приводящее к ее пластической деформации. Изучение свойств дефектов, вводимых в кристалл путем индентирования, приобретает особое значение в случае материалов с низким пределом упругости, как, например, КРТ, поскольку при создании приборов на его основе в кристалле могут возникать дефекты деформационного происхождения при стандартных технологических операциях типа механической обработки поверхности, термообработки, термокомпрессионного приваривания контактов и т. п. Как было впервые показано в [8], в КРТ уже при  $P \approx 2.5$  кбар и  $T \approx 300$  К обнаруживается пластическое течение, которое сопровождается генерацией электрически активных точечных дефектов. В [9] высказано предположение о том, что дислокации и точечные дефекты, появляющиеся при пластической деформации кристалла, обладают донорными свойствами и являются эффективными центрами рекомбинации. Авторы [10] пришли к заключению, что точечные дефекты действительно выступают как доноры, но дислокации не проявляют геттерирующего действия по отношению к остаточным примесям, что, вообще говоря, отличается от результатов, полученных в аналогичной ситуации для Ge и Si (см., например, [11]). В то же время динамика развития дислокационной структуры, природа точечных

дефектов и характер их влияния на электрофизические параметры (Cd, Hg) установлены не были.

В данной работе представлены результаты исследований температурных зависимостей гальваномагнитных и фотоэлектрических параметров пластически деформированных кристаллов  $n$ -КРТ ( $x \approx 0.22$ ), которые, по нашему мнению, позволяют получить ответы на некоторые из этих вопросов. Пластическая деформация образцов, имеющих форму параллелепипеда (типовные размеры  $6 \times 2 \times 1$  мм), осуществлялась индентированием одной из широких граней с помощью четырехгранного индентора с нагрузкой 10 г. Плотность индентирования  $1 \cdot 10^4$  см $^{-2}$ .

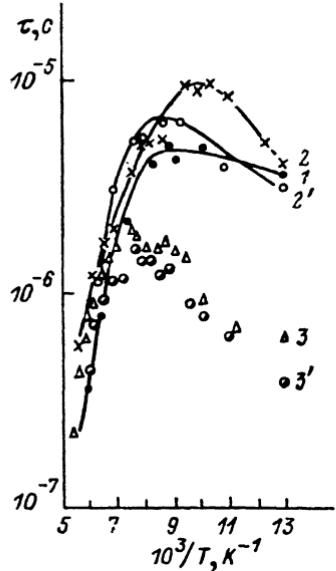


Рис. 1. Зависимость  $\tau$  ( $1/T$ ) для образца БК-6 ( $x=0.225$ ).

1 — исходный образец, 2 —  $t \sim 10^8$ , 2' —  $t \sim 10^8$  с (обратная сторона); 3, 3' — индентированная и обратная стороны соответственно после появления аномалии на  $R_X$  ( $1/T$ ).

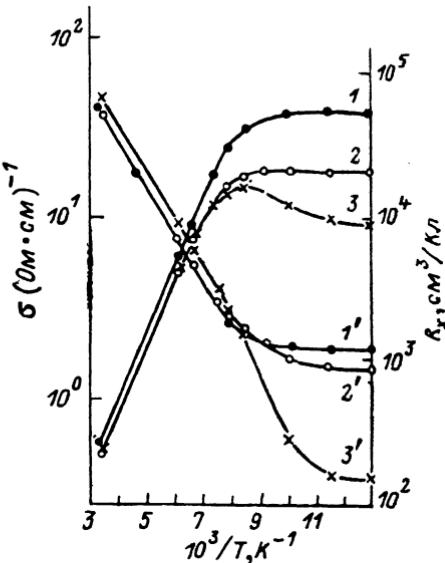


Рис. 2. Зависимости  $R_X$  ( $1/T$ ) (1—3) и  $\sigma$  ( $1/T$ ) (1'—3') для того же образца.

1, 1' — исходный образец; 2, 2' —  $t \sim 10^8$ , 3, 3' —  $t \sim 10^8$  с.

Параметры исследованных образцов, приведенные в таблице, получены из измерений температурных зависимостей проводимости  $\sigma$ , коэффициента Холла  $R_X$  и времени жизни ННЗ  $\tau$ . Последнее определялось при помощи GaAs-лазера ( $\lambda \sim 0.93$  мкм) по экспоненциальному затуханию длинновременной части сигнала фотоотклика при низком уровне возбуждения (потоком  $\sim 10^{15}$  фот/см $^2$ ·с). Контрольные измерения, проведенные с использованием CO<sub>2</sub>-лазера ( $\lambda \sim 10.4$  мкм), дали те же значения  $\tau$ , что позволяет считать измеряемое в наших опытах время жизни близким к объемному.

При расчетах температурных зависимостей времени жизни ННЗ учитывались в основном три механизма рекомбинации: межзонные оже- и излучательная рекомбинации, а также рекомбинация через локальные центры в модели Шокли—Рида [1—3]. На рис. 1 представлены типичные зависимости  $\tau$  ( $T^{-1}$ ), полученные на одном из исследуемых образцов. Сразу же после индентирования происходит небольшое падение  $\tau$  в области  $T \lesssim 125$  К. Через некоторое время ( $\sim 10^8$  с) значения  $\tau$  начинали увеличиваться, что сопровождалось и увеличением наклона  $\tau$  ( $T^{-1}$ ) в этой же области температур. Через  $(6 \div 7) \cdot 10^8$  с отмеченные выше изменения достигали максимума. При этом результаты, полученные при измерении  $\tau$  на индентированной и обратной плоскостях образца, слабо различались между собой (рис. 1, кривые 2, 2'). В дальнейшем на всех образцах наблюдалось резкое падение времени жизни ННЗ (почти на порядок) (рис. 1, кривые 3, 3').

Результаты измерений коэффициента Холла и удельной проводимости исследованных образцов, проведенных через те же промежутки времени  $t$  (рис. 2),

№ образца	Время измерения, с	$R_X$ (77 К), $\text{см}^3/\text{Кл}$	$\rho$ (77 К), $\Omega \cdot \text{см}$	$(R_X/\rho)$ (77 К), $\text{см}^2/\text{В} \cdot \text{с}$	$E_t$ , мэВ	$N_t$ , $\text{см}^{-3}$	$S$ , $\text{см}^2$	$\tau$ (77 К), с	$x$
1 (БК-6)	Исходный	$5.24 \cdot 10^4$	$5.25 \cdot 10^{-1}$	$9.97 \cdot 10^4$	110	$5.56 \cdot 10^{13}$	$10^{-16}$	$4 \cdot 10^{-6}$	0.225
	$6 \cdot 10^5$	$2.06 \cdot 10^4$	$6.91 \cdot 10^{-1}$	$2.98 \cdot 10^4$	40	$1.95 \cdot 10^{15}$	$10^{-16}$	$4 \cdot 10^{-6}$	0.220
	Обратная сторона	$2.06 \cdot 10^4$	$6.91 \cdot 10^{-1}$	$2.98 \cdot 10^4$	86	$8.3 \cdot 10^{13}$	$10^{-16}$	$3.2 \cdot 10^{-6}$	0.225
2	$7 \cdot 10^6$	$8.96 \cdot 10^3$	2.754	$3.25 \cdot 10^3$			$10^{-16}$	$4.8 \cdot 10^{-7}$	
	Исходный	$3.5 \cdot 10^4$	$9.8 \cdot 10^{-1}$	$3.56 \cdot 10^4$	76	$1.8 \cdot 10^{13}$	$10^{-16}$	$7 \cdot 10^{-6}$	0.212
	$1 \cdot 10^4$	$3.5 \cdot 10^4$	$9.8 \cdot 10^{-1}$	$3.56 \cdot 10^4$	75	$4.6 \cdot 10^{13}$	$10^{-16}$	$3.5 \cdot 10^{-6}$	0.212
	$7 \cdot 10^4$				60	$7 \cdot 10^{13}$	$10^{-16}$	$3.5 \cdot 10^{-6}$	0.212
3	$6 \cdot 10^5$	$1.09 \cdot 10^4$	1.69	$6.4 \cdot 10^3$				$1 \cdot 10^{-7}$	0.212
	Исходный	$7.08 \cdot 10^4$	$3.53 \cdot 10^{-1}$	$2 \cdot 10^5$	77	$5 \cdot 10^{13}$	$10^{-16}$	$5 \cdot 10^{-6}$	0.22
	$1 \cdot 10^4$	$7.08 \cdot 10^4$	$3.53 \cdot 10^{-1}$	$2 \cdot 10^5$	68	$1.6 \cdot 10^{14}$	$10^{-16}$	$2 \cdot 10^{-6}$	0.22
	$7 \cdot 10^5$	$8.8 \cdot 10^3$	1.78	$4.93 \cdot 10^3$				$1.5 \cdot 10^{-6}$	0.22

можно описать следующим образом: в исходных образцах наблюдалась типичные для  $n$ -КРТ зависимости  $R_X(T^{-1})$  и  $\sigma(T^{-1})$  с экспоненциальным участком в области  $T > 125$  К (собственная проводимость — участок I) и выходом на насыщение в области  $T < 125$  К (примесная проводимость — участок II). После индентирования происходило некоторое уменьшение  $R_X$  на участке II, где со временем появлялся максимум, возникновение которого по времени совпадало с резким падением  $\tau$ . В дальнейшем на некоторых образцах обнаруживалась даже инверсия знака коэффициента Холла.

Наблюдаемая немонотонная зависимость изменения времени жизни  $\tau$  при увеличении времени  $t$ , прошедшего после снятия нагрузки с образцов КРТ, может быть объяснена следующим образом. Незначительное спадание  $\tau$  сразу

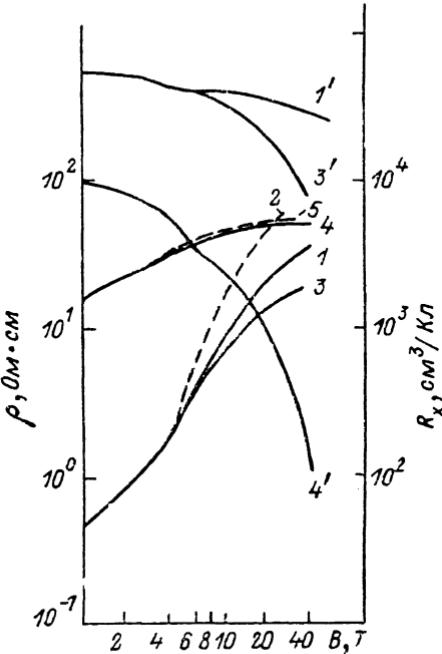


Рис. 3. Магнитополевые зависимости  $\rho$  (1–5) и  $R_X$  (1', 3', 4') для исходного образца (1–3, 1', 3'), для индентированного образца через  $t \sim 10^6$  с (4', 4', 5').

Т, К: 1, 1', 3, 3', 4, 4' — 4.2; 2, 5 — 1.6. 3, 3' — не-травленый образец, остальные кривые получены на свежетравленном образце.

после индентирования можно связать с появлением новых центров рекомбинации вблизи поверхности кристалла из-за нарушений его структуры [12]. Возникающие при этом механические напряжения в кристалле будут затем снижаться посредством появляющихся дислокаций, движущихся с определенными скоростями от поверхностных нарушений в глубь кристалла по плоскостям скольжения. Это движение сопровождается образованием вокруг ядра дислокаций примесной атмосферы. Как показывает расчет [13], блокирование «свежей» дислокаций атомами меди происходит при комнатной температуре примерно за 1000 с. Образование вокруг дислокаций примесных атмосфер другими точечными дефектами происходит за более длительные времена ( $\sim 10^6$  с) в соответствии с их коэффициентами диффузии. Если учесть, что эффективный уровень, использованный в расчетах времени рекомбинации в модели Шокли—Рида, непосредственно связан с неконтролируемыми примесями (в частности, с примесью меди), то наблюдаемое увеличение  $\tau$  спустя некоторое время после снятия механической нагрузки является, по нашему мнению, следствием геттерного очищения объема образца от остаточных рекомбинационно активных примесей и дефектов в про-

цессе прорастания дислокаций. Через  $t \sim 10^5$  с после индентирования концентрация примесей, ответственных за эффективный уровень Шокли—Рида, становится достаточно малой, для того чтобы мог проявиться новый уровень с энергией  $E_s + (50 \pm 10)$  мэВ. Этот уровень наблюдается на всех индентированных образцах независимо от их первоначальных характеристик. Поэтому скорее всего он имеет дислокационную природу, хотя сказать что-либо конкретное о его структуре в данное время затруднительно.

Распространение дислокационных полей по кристаллу может привести еще к одному эффекту, который становится особенно заметным после их перекрытия. В работах [14, 15] показано, что при определенной плотности дислокаций образовавшиеся вокруг них примесные атмосферы могут создать связанный канал проводимости  $p$ -типа, который либо шунтирует проводимость по матрице, либо вообще разрывает ее связность. По нашему мнению, именно с этим и связаны качественные изменения, наблюдаемые на зависимостях  $R_x (T^{-1})$  и  $\tau (T^{-1})$ . Наблюданное на опыте (в области II) уменьшение значений  $R_x$  трудно связать с увеличением концентрации доноров, так как такое увеличение должно было бы приводить к значительно меньшим изменениям подвижности, чем те, которые наблюдались в наших исследованиях (см. таблицу). Подобные изменения  $\mu$  и  $R_x$  после индентирования наблюдались также и в работе [10]. Если созданное индентированием дислокационные области отделяют друг от друга участки проводимости  $n$ -типа, препятствуя переносу электронов из одного конца образца в другой, то в этом случае непрерывность электрического тока (и фототока) через образец обеспечивается только каналами с  $p$ -проводимостью вдоль образованных индентированием дислокационных областей. Это и приводит через  $t \geq 10^6$  с к резкому падению  $\tau$  и появлению аномалий на зависимостях  $R_x (T^{-1})$ . Дополнительным подтверждением наличия такого канала проводимости служит вид магнитополевых зависимостей  $R_x = R_x(B)$  и  $\rho = \rho(B)$ , измеренных на одном из образцов до индентирования и после появления аномалий на температурной зависимости  $R_x (T^{-1})$  (рис. 3). Обращают на себя внимание и очень малая величина магнитоопротивления  $\rho (B)$  в индентированном образце и тенденция его выхода на насыщение, отсутствие температурной зависимости  $\rho (T)$  в сильных магнитных полях (рис. 3, кривые 4, 5) в отличие от исходного кристалла (рис. 3, кривые 1—3). На зависимости  $R_x (B)$  в индентированном образце наблюдаются резкий спад и даже инверсия знака коэффициента Холла. Отмеченные особенности не исчезают и после травления образца, о чем свидетельствует сравнение результатов, полученных на нетравленых (рис. 3, кривые 3, 3') и свежетравленных образцах (все остальные кривые того же рисунка).

Таким образом, пластическая деформация кристаллов  $Cd_x Hg_{1-x} Te$  ( $x \approx 0.22$ ), осуществляемая посредством индентирования, приводит к образованию подвижных при комнатной температуре дислокаций, проявляющихся геттерирующее действие по отношению к имеющимся в образце неконтролируемым примесям. Установлено также, что наблюдаемый в деформированном кристалле КРТ ( $x \approx 0.22$ ) рекомбинационный уровень с  $E_s \sim E_s + 50$  мэВ имеет дислокационную природу.

#### Список литературы

- [1] Kinch M. A., Brau M. J., Simmons A. // J. Appl. Phys. 1973. V. 44. N 4. P. 1649—1663.
- [2] Баженов Н. Л., Гельмонт Б. Л., Иванов-Омский В. И., Малькова А. А., Огородников В. К., Тотиева Т. Ц. // ФТП. 1982. Т. 16. В. 1. С. 109—112.
- [3] Pratt R. G., Hewett J., Capper P., Jones C. L., Judd N. // J. Appl. Phys. 1986. V. 60. N 7. P. 2377—2385.
- [4] Nimtz G., Muller K.-H. // Phys. St. Sol. (a). 1974. V. 22. N 2. P. K215—K218.
- [5] Voitsekhevski A. V., Lilienko Yu. V., Kokhanenko A. P., Petrov A. S. // Rad. Eff. 1982. V. 66. N 1-2. P. 79—84.
- [6] Абдинов А. Ш., Мамедов Ф. И., Сенджи Г. С. // Неравновесные процессы в сложных полупроводниках. Баку, 1987. С. 78—84.
- [7] Громовой Ю. С., Дякин В. В., Коваль В. В. // Матер. VII Всес. симп. «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы». Львов, 1986. Ч. I. С. 167—169.
- [8] Барабанский П. И., Гаврилюк Ю. Н., Елизаров А. И., Кулик В. А. // ФТП. 1977. Т. 11. В. 8. С. 1360—1564.
- [9] Гасан-заде С. Г., Сальков Е. А., Шепельский Г. А. // ФТП. 1983. Т. 17. В. 11. С. 1913—1917.

- [10] Tregilgas J. H., Polgreen T. L., Chen M. C. // J. Cryst. Growth. 1988. V. 86. N 1-4. P. 460—466.
- [11] Никитенко В. И., Якимов Е. Б. // Материалы электронной техники. Новосибирск, 1983. Ч. II. С. 62—79.
- [12] Власенко А. И., Любченко А. В., Сальков Е. А. // УФЖ. 1980. Т. 25. В. 3. С. 434—441.
- [13] Комай В. П., Притуляк Б. Б. // Метер. VII Всес. симп. «Полупроводники с узкой запрещенной зоной и полуметаллы». Львов, 1986. Ч. I. С. 196—198.
- [14] Балев О. Г., Барабанский П. И., Бекетов Г. В., Винецкий Р. М., Городничий О. П. // ФТП. 1987. Т. 21. В. 6. С. 1021—1025.
- [15] Елизаров А. И., Иванов-Омский В. И., Корниш А. А., Петряков В. А. // ФТП. 1984. Т. 18. В. 2. С. 201—205.

Институт полупроводников АН УССР  
Киев

Получена 13.06.1989  
Принята к печати 1.09.1989